**K103半導體中心**

**非上班/上課時間使用儀器申請表**

 申請日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請人姓名 |  | 手機號碼 |  |
| 隸屬單位 | 班級： | 申請使用時段 | 日期： |
| 學號： | 時間： |
| 指導教授 | （簽名） | 年 月 日 |
| 系辦/單位主管 | （簽名） | 年 月 日 |
| 使用儀器項目：* 四點探針量測儀 □金相顯微鏡 □太陽能模擬器 □排煙櫃 □黃光室
* 高溫爐(退火爐) □熱蒸鍍機 □OLED □E-Beam □Sputter濺鍍機
 |
| 申請說明：1. 使用人員請確實於值勤紀錄簿中記載姓名、進入之目的及進入、離開之時間，並於該儀器使用紀錄簿中登記。
2. 各項詳細規定請參閱中心使用管理辦法。
3. 若有發現使用該機台不正常時，請立即停止使用。需向儀器負責老師報告，並記載在值勤記錄簿中。
4. 使用者使用完畢時需確實檢查該使用儀器水、氣 、電設備是否完全關閉後方可離開，否則經發現有問題需負完全責任。
5. 使用者中最後離開的人必須將無塵室的水、氣、電源(燈)關閉。
6. 此申請表最晚須在使用時段前半日完成申請手續。
7. 即日起須加填總務處保管組「[非上課時段留校申請書](https://gen.stust.edu.tw/tc/node/Gen34)」及「[留校聲明書](https://gen.stust.edu.tw/tc/node/Gen34)」。

<https://gen.stust.edu.tw/tc/node/Gen34>1. 連續申請留校最多每次以7天為限(含例假日)。

註：實驗室開放申請時間：週一至週五9:00－22:00、週六/日 10:00－18:00。 |

111年6月版